

1. まえがき

情報センシング分野では、センサを用いた画像および関 連する空間情報の入力と処理にかかわる技術を対象として いる.センサとは、自然界に存在する物理量を検出して、 電気信号に変換するデバイスのことを指すが、センサの中 でも、画像信号をとらえるイメージセンサは、今日では、 スマートフォンやディジタルカメラなどの電子機器に広く 搭載され、世界中の人々が日常的に利用するようになった. また、他の用途への利用も拡大し続けており、イメージセ ンサの世界市場は、この3年間においても、大きな成長を 遂げている.イメージセンサは、近い将来に到来する生体 レベルから宇宙を含む地球規模のセンサ・ネットワーク社 会で中心的な役割を演じるものとなるであろう.

本稿は,情報センシング研究委員会の委員が分担して, 情報センシング分野の中から,ここ3年の進展が著しい技 術として,イメージセンサにおけるセンサ構造・材料,回

†1 東北大学 大学院工学研究科
†2 NHK 放送技術研究所
†3 北海道大学 大学院情報科学研究科
†4 オン・セミコンダクター
†5 キヤノン株式会社
†6 東京理科大学 工学部 電気工学科
†7 埼玉大学 大学院理工学研究科
†8 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科
†9 株式会社ニコン
†10 パナソニック株式会社
†11 豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所
†12 浜松ホトニクス株式会社
"Image Electronics Information Sensing" by Shigetoshi Sugawa, Rihito

Image Electronics Information Sensing by Shigetoshi Sugawa, Kihito Kuroda (Graduate School of Engineering, Tohoku University, Miyagi), Hiroshi Ohtake, Takayuki Yamashita (Science and Technology Research Laboratories, NHK, Tokyo), Masayuki Ikebe (Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Hokkaido), Toshiaki Sato (ON Semiconductor, Tokyo), Masahiro Kobayashi (Canon Inc., Kanagawa), Takayuki Hamamoto (Faculty of Engineering, Tokyo University of Science, Tokyo), Takashi Komuro (Graduate School of Science and Engineering, Saitama University, Saitama), Takashi Tokuda (Graduate School of Materials Science, Nara Institute of Science Technology, Nara), Shiro Tsunai (Nikon Corporation, Tokyo), Yutaka Hirose (Panasonic Corporation, Kyoto), Daisuke Akai (Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute, Toyohashi University of Technology, Aichi), Hiroo Yamamoto (Hamamatsu Photonics K.K., Shizuoka) 路技術,画素微細化・多画素化,高感度・低ノイズ化,高 速化・広ダイナミックレンジ化・広波長化,画像処理,特 殊機能,カメラにおける放送用カメラ・高精細カメラ,携 帯電話用カメラ・ディジタルカメラ・ビデオカメラ,車載 用カメラ・セキュリティ用カメラ・産業用カメラ,不可視 光撮像における赤外線,X線の技術についてまとめる.

2. イメージセンサ

2.1 センサ構造・材料

これまでのイメージセンサの進展を振り返ると, CCDか らCMOSへの移行により,駆動電圧の低電圧化,低消費電 力化,高速化,多画素化を達成してきた.さらに,裏面照 射構造の開発により,画素の微細化に伴う光利用率の低下 を大幅に改善し,チップサイズおよび画素サイズが縮小し ても高感度化が実現されてきた.ここ3年間を振り返ると, 裏面照射型イメージセンサは,ロジック回路を集積化した 支持基板をThrough Silicon Via (TSV)で電気的に接続し た3次元積層型イメージセンサへと進化し,本格的に実用 化されたこと,また,有機材料などシリコン以外の光電変 換膜をCMOS回路上に積層した光電変換膜積層型イメージ センサの開発が活発化してきたことなど,センサ構造や材 料に関する研究開発が行われたことが特徴的であった.こ こでは,センサ構造・材料をキーワードとして,代表的な 報告を紹介する.

画素サイズの微細化による感度の低下は裏面照射構造によ り解決され,飽和信号量の確保とクロストーク(混色)の抑 圧が次の課題となっていた.その解決に向けて,転送ゲー トを縦型構造にすることと,遮光メタルを埋め込むことで 飽和信号の増大と混色抑制を行った画素サイズ1.2µmの裏 面照射型イメージセンサが報告された¹⁾.また,レンズの像 面湾曲収差を克服するため,半球状に湾曲した裏面照射型 イメージセンサが開発された²⁾.中心で感度を2倍,端部で 1.4倍の感度向上を実現している.また,湾曲形状にするこ とにより,センサの引張り応力がエネルギーバンドギャッ プを広げる働きをすることで暗電流が1/5に低減した.

すべての画素をオートフォーカス用の位相差検出画素に 割当てたCMOSイメージセンサが報告された³⁾⁴⁾.一つの マイクロレンズの下に二つのフォトダイオードを設けた画 素構造により,全画素から信号情報と位相差情報を高速に 読出すことができる.

1 µm以下の画素サイズにおいても、良好な感度と広いダ イナミックレンジを実現するために、CMOS回路上の画素 部全面に有機光電変換膜を積層したイメージセンサが開発 された5). 有機膜はシリコンフォトダイオードに比べて吸収 係数が高いため、薄膜化が可能であり、クロストークの低 減にも有効である.また、画素設計の自由度が高く飽和電 荷量を大きく設計することができる. 膜積層センサの課題 であるリセットノイズについては, 負帰還ノイズ抑圧回路 の適用により、ほぼ問題のないレベルに抑えられたと報告 されている. また, 2016年のInternational Solid-State Circuits Conference (ISSCC) では、2件の有機CMOSイメー ジセンサが報告された.一つは、画素を高感度画素と低感 度画素に分け、信号合成により120dBのダイナミックレン ジを実現するとともに、ノイズキャンセル回路の改良によ りノイズ電子数1.6電子を実現した6).もう一つは、有機膜 内で発生する信号の生成消滅を動的に制御することでグロー バルシャッタや電子シャッタ機能を実現したものである7).

光電変換膜積層型のイメージセンサとして,単結晶セレ ン膜や⁸⁾⁹⁾, CIGS膜を積層したもの¹⁰⁾も報告された.これ らは,光電変換膜内でのアバランシェ増倍による高感度化 を目指したもので将来の高感度技術として有望と考えられ る.また,シリコン回路上に耐圧の高い結晶性酸化物半導 体を積層し,その上に光電変換膜を積層したデバイスも報 告された¹¹⁾.

赤,緑,青色にのみ感度を持つ有機光電変換膜と透明な 酸化物半導体で形成した回路とを積層することで深さ方向 に光を捉える有機撮像デバイスについて,色ごとのフォー カスずれを解決するための直接積層型のセンサの試作結果 が報告された¹²⁾.デバイスの形成温度を有機膜の耐熱温度 以下の150℃で製作するためのプロセスを開発し,トータ ルの厚み5.4 µmでの試作に成功している.さらに,赤,緑 用の積層構造と,青色用のデバイスを向かい合わせ,貼り 合わせることで,製造歩留まりを向上させる試みも報告さ れた¹³⁾.

3次元積層型イメージセンサについては、上側の裏面照 射センサと下側の回路基板とを7.6 µmピッチ400万個のバ ンプにより接続した1,600万画素のイメージセンサ¹⁴⁾や, TSVとハイブリッドスタッキング技術による8Kスーパー ハイビジョン用1.1 µm画素3,300万画素240fps 3次元積層 イメージセンサ¹⁵⁾,完全画素並列処理を目指し、全画素に 接合電極を形成し、直接接合技術により接合形成したイメ ージセンサの試作結果が報告された¹⁶⁾.

ここでは、構造や材料という観点から特筆すべき報告を 紹介した.今後もより一層の研究開発により性能・機能向 上が期待される. (大竹)

2.2 回路技術

イメージセンサの高解像度化・高速化に合わせ,センサ 用のカラム A/D変換技術の研究開発も継続されている.セ ンサ研究開発における重要な要素として,低ノイズ・高速 動作・小面積・線形性(特に微分線形直線性 DNL: Differential Non Linearity)・低電力があげられる.カラム A/D変換器として,高解像度センサに向けたさまざまな高 速化手法の提案がなされるとともに,近年,画素値のサン プリングに関連した低ノイズ化手法に注目が集まってい る.容量値Cに対する信号のサンプリングにおいて,ラン ダムノイズである熱雑音の総量は,kT/C(k:ボルツマン 定数,T:温度)となる.入力信号の再現性が高い場合, 同一条件で信号のサンプリングをn回行って加算平均する ことで,ランダムノイズに対するS/N比が改善する.この とき,ノイズ成分は $1/\sqrt{n}$ となるため,S/N比は \sqrt{n} 倍改善 される¹⁷⁾.

平均化を行うためには、マルチサンプリング(複数回のサ ンプリング)が必要となる.逐次的な手法と複数回路による 手法とに大きく分かれ、主に前者からの提案が多い.逐次 的なサンプリング手法として、まずΔΣ型A/D変換器が挙 げられる.DC成分に対するオーバサンプリングは、まさに マルチサンプリングと等価であり、積分出力を行うことで 平均化と同じ効果を得る.また、量子化雑音に対するノイ ズシェーピング効果から、1ビットの2次ΔΣ型A/D変換器 の場合,DC成分に対してNビット精度を得る場合N=log2M (M+1)-1としてM回のサンプリングを行えば良い.110回 ほどのサンプリングで14ビット精度を得ることができる¹⁸.

マルチサンプリング出力を積分し,折り返し型アンプによって出力しA/D変換する手法も提案されている.マルチサンプリングによる積分出力は,上位ビットに対応する信号範囲ごとに,中間信号電圧が折り返されて出力される.その中間信号電圧を,サイクリック型の下位ビットA/D変換を行う.80 µVrmsの低ノイズ化,ダイナミックレンジ82 dB,13から19ビット精度を実現している¹⁹⁾.

近年は、シングルスロープ A/D 変換器を用いた、逐次的 マルチサンプリング手法の提案も盛んである。暗部の A/D 変換の場合,信号電荷(電子)の発生が少ないため、リセッ ト電圧からの変化が少なく、ランプ信号と画素信号の比較が 変換時間の速い段階で終了する。そのため、残りの変換時間 に対して、マルチサンプリングを行う。手法としては、比較 器の反転タイミングにより暗部・明部を検出して、シングル /マルチサンプリングを切替える(サンプリング回数5回で 1.28 e-rmsから0.66 e-rmsのノイズ低減)²⁰⁾、比較器の反転時に、 ある一定の電圧範囲内でランプ信号を複数回折り返すものが 提案されている(サンプリング回数105回で160 µVrmsから 186 µVrmsへノイズ低減)²¹⁾.

逐次比較型 A/D 変換器では、マルチサンプリング手法を 下位ビットの変換に用いる手法が提案されている.上位8ビ ットの変換により信号電圧範囲を特定し、下位4ビットの変換を複数回行い、それを平均化する.逐次比較型 A/D変換器では、下位ビット変換に用いる容量値は小さくなるため、 省電力化の効果も同時に得ることができる.試作センサにより225 µV_{rms}から96.5 µV_{rms}へノイズ低減を実現した²²⁾.

単一画素値に対して,複数のA/D変換器を用いてマルチ サンプリングを行うものとして,積層センサの特徴を活かし た手法が提案されている.積層型センサでは,ピクセル部と ロジック部にそれぞれ適切なプロセスを割当てることができ る.そこで,カラムA/D変換器のロジック部を高集積化す ることで,2倍のA/D変換器を実装し,同一変換時間でのマ ルチサンプリングを実現した(1.3ermsのノイズ低減)²³⁾.

また、カラム部のソースフォロアの駆動手法に着目し、 低ノイズ化を図る報告もされている.本来、ソースフォロ アの負荷素子として、定電流駆動MOSFETのドレイン抵 抗を用いているが、定電流を生じさせない浮遊容量負荷と することで、信号出力に積分とドレイン接地の負帰還効果 を持たせることができる.充分な読出し速度も確保でき、 浮遊容量負荷読出しにより、0.74 e-rmsから0.46 e-rmsのノイ ズ低減を実現している²⁴⁾. (池辺)

2.3 画素微細化・多画素化

中国市場の景気減速が大いに懸念される昨今ではある が,世界のイメージセンサ市場はこの3年間順調に成長を 続け,今後も年率10%強の高い成長が見込まれている.イ メージセンサ市場の内訳は2013年には携帯電話,スマート フォンおよびタブレットがおよそ90%を占めていたが,近 年は特に車載カメラ,セキュリティカメラなどの分野での 成長が著しい.

そういった中,カメラの高画質化,小型化などの要求か ら依然、スマートフォン市場が画素の微細化技術を牽引し ている.スマートフォンカメラ向けのCMOSイメージセン サの画素数は、2013年当時500万から800万画素が主流で あったが、現在は1,200万から1,300万画素が主流となって いる. 画素サイズはこの間に1.75 µmクラスから順次縮小 され、量産品ベースでは1.12 µmが現行最小画素サイズと なっている. 2015年にはOmniVision社²⁵⁾とSamsung社²⁶⁾ が、2016年2月にはSony社27)が1.0 µm 画素を搭載したセ ンサの製品化を発表していよいよサブミクロン画素時代の 到来を予感させているが、その一方で画素シュリンクに関 する研究発表は、ここ数年頭打ちの傾向が若干見受けられ る. 画素の微細化に伴う感度低下, 色ノイズを含めたS/N の改善が重要な研究開発課題である.前記3社は積層型 CMOSセンサ技術を採用しており、センサチップのBSI (Back Side Illumination) 化による感度向上のみならず,処 理チップを分離することで画素プロセスの最適化を可能に し特性改善を図っていると見られる. IISW (International Image Sensor Workshop) 2015では、V.C. Veneziaら (OmniVision社) はカスタマイズした NMOS-pixel プロセス

を用いて、1.0 μ m 画素にて飽和電荷数6,500 e-, 暗電流 (@60°C) 4 e-/sec, 読出しノイズ (@×16 gain) 1.5 e-の性能 を達成したとした²⁸⁾. V.C. Veneziaらはまた, BCFA (Buried Color Filter Array) と, B-DTI (Backside Deep Trench Isolation)を用いることにより、シリコン表面近く にカラーフィルタを形成して量子効率の低下を抑え、かつ クロストークを低減することで上記性能を達成したとし た.前記Samsung社も同様の画素分離構造を採用してい る²⁹⁾. このように光の利用効率を高める光学的特性の改善 もまた必要不可欠の技術である.

ー方,従来のシリコンフォトダイオードに代わる光電変 換材料の研究開発が注目されてきた. IDEM (International Electron Devices Meeting) 2015で, M. Takaseら (Panasonic社)は有機薄膜を用いた画素サイズ $0.9 \mu m$ のグ ローバルシャッタCMOSイメージセンサを報告した³⁰⁾. 有 機薄膜は光吸収係数が大きく薄膜化が可能であり,また受 光面積をほぼ画素全域に形成できるため,高い光利用効率 が期待できる技術である.

多画素化においては、画素サイズはやや大きめであるも のの1億画素を超える報告が出てきた. R. Funatsuら (NHK, Forza Silicon社)はISSCC 2015で単板8Kスーパー ハイビジョンカメラ用の1億3,300万画素センサ³¹⁾を, H. Totsukaら(Canon)はISSCC 2016でその倍近い画素数の2 億5千万画素を有するセンサ³²⁾を報告した.2020年東京オ リンピック・パラリンピックへ向けた8Kスーパーハイビ ジョン放送の本格開始と相まって,民生用8Kカメラの普 及もまた期待される. (佐藤)

2.4 高感度化・低ノイズ化

近年のイメージセンサにおいて、感度向上に対する大き なブレークスルーの一つである裏面照射型CMOSイメージ センサの開発発表から8年が経過した³³⁾.当初は問題の一 つとして色分離性が挙げられていたが、カラーフィルタ領 域にも遮光部材を設ける構造や,DTI (Deep Trench Isolation)と呼ばれるSi内に設けた分離層を用いて色分離 性を改善する構造などが提案され³⁴⁾,多くのディジタルカ メラやスマートフォンなどで,画素サイズが1.4µm以下の 裏面照射型CMOSイメージセンサが採用されている. さら に、APS-Cサイズや35mmフルサイズの光学フォーマット で裏面照射型を採用した例もある35)36).しかしながら、こ こ数年は画素サイズの微細化スピードが鈍化し、裏面照射 型CMOSイメージセンサを用いた高感度化技術も成熟して きたとの見方が大勢となってきた.ポストCMOSイメージ センサ、ポストSiフォトダイオードに関する議論はこれま でもなされてきたが、いよいよ現実味を帯びてきたと言え る.以上を踏まえ、高感度化および低ノイズ化それぞれに 関して述べる.

高感度化に関しては,有機光電膜や量子ドットフィルムを 用いたイメージセンサ,グローバル電子シャッタ機能と高

感度を両立したもの, Siを用いたまま可視光以外へも検知感 度を拡大させたもの、星明かり以下の照度でもカラー撮影 が可能な超高感度カメラなど、さまざまな技術・製品が積 極的に提案・発表された. 有機積層型イメージセンサはこ れまでも報告されていたが、リセットノイズ (kTCノイズ) の低減が依然として課題の一つであった.これに対し、フ ィードバックアンプと容量で容量結合型ノイズキャンセル 回路を構成し、リセットノイズを1.6e-まで低減する技術が 提案された³⁷⁾. また, CMOS回路上にQuantum Filmと呼ば れる量子ドットで構成された膜を設け,外部量子効率を従 来のSi比で1.5~2倍程度に向上可能とする技術を製品化し た発表もなされた38).いずれも現時点では膜の信頼性や暗 電流などに難があることが予想されるが、Siの量子効率とい う制限を超える可能性のある技術として今後の展開が楽し みである. さらに、フォトダイオードとストレージノード とをそれぞれ異なる Si 基板に形成しマイクロバンプで接合 することで、グローバル電子シャッタ機能を有しながら、 高感度かつ-180dBという高い寄生光感度耐性を実現した ものが提案された³⁹⁾.また,原子レベルで平坦なSi基板に, 浅く急峻な表面p型層と20µmの厚いエピ層を用いて、190 ~1000nmまでの幅広い波長の光に高い感度を持つイメージ センサが提案された40). 一方, 画素サイズは19µmと大きい ながらも、最低被写体照度0.5 mlux, ISO 感度400万相当を実 現するとするカメラも発売された41). これらの技術開発は いずれもイメージセンサの用途を拡大する意味でも非常に 興味深い.

低ノイズ化に関しても、入力換算ノイズで1e-を大きく下 回るレベルまで開発が進められた. E. Fossum氏が提唱し たQuanta imaging⁴²⁾の実現にまた一歩近づいていると言え る.入力換算ノイズ低減のためのアプローチは大きく分け て二つあり、一つは電荷を電圧に変換する効率(電荷変換 効率)を大きくすること、もう一つは光電変換後にイメー ジセンサの至る所で生じるノイズそのものを低減すること である.前者の例としては、電荷変換効率を上げるために FD (Floating Diffusion)の容量を高精度に見積もった上で、 拡散層の構成や濃度の見直し等により、180 nm プロセスで FD容量0.66fF, 電荷変換効率243µV/e-, 読出しノイズ0.43 e-を達成したとする報告がなされた43). 同様のアプローチ として, E. Fossum氏らは65 nm プロセスで電荷変換効率 426µV/e-, 読出しノイズ0.34e-のイメージセンサを作製し, アバランシェ増幅を用いずに、入射光を量子的に捉えること に成功したと報告した44).一方,後者のアプローチの一つと して, 画素ソースフォロワアンプ (画素 SFA) で生じるノイ ズを低減するために埋込トランジスタやp型チャネルが有用 であることが以前より示されている. IISW 2015においても, 画素SFAのチャネルをp型チャネル化した報告が3件なされ た^{45)~47)}. さらに, 画素SFAのゲート酸化膜を薄くするこ とで読出しノイズ0.4 e-を達成したとする報告⁴⁶⁾,および,

画素SFAのゲート界面における電荷のトラップ状態の相関 をなくすために、チャネルの蓄積状態と反転状態とを素早 く往復させマルチサンプリング効果を高め、読出しノイズ 0.33 e-を達成したとする報告がなされた⁴⁷⁾. さらには、リセ ットトランジスタを削減してFD容量を低減するとともに、 AD (Analog to Digital)変換回路においてマルチサンプリン グを行い、-10℃環境下で0.27 e-という読出しノイズを達 成したとする報告もある⁴⁸⁾.

近年のイメージセンサにおける最大の需要の担い手であ るスマートフォンは、高感度化と低ノイズ化の恩恵を存分 に受け、ますます高画質撮影が可能となっている.しかし ながら、すべてのユーザが満足しているわけではなく、高 感度化、低ノイズ化、高解像度化、広ダイナミックレンジ 化に対しての要求は留まるところを知らない.今後はスマ ートフォンに加え、監視カメラ、マシンビジョンやドロー ンなどといった新たなイメージセンサの需要の創出に向 け、ますます技術の進展を続けていくと考えられる.(小林)

2.5 高速化・広ダイナミックレンジ化・広波長化

連続撮像型のイメージセンサの高速化においては、列回路 技術の進展と積層化技術の利用によって、多画素数・高出 カレートのCMOSイメージセンサの提案がなされた.32列 共用の逐次比較型 ADCを有する CMOSイメージセンサでは 画素サイズ2.45 μ m角、総画素数15488^{H×} 8776^V(有効1億 3,300万画素)において112チャネル並列出力で128.7 Gbpsの データレート、撮像速度60 fpsを達成している⁴⁹⁾.また、画 素領域に4.4 μ mピッチで配線接続を設けた画素1.1 μ m角、 サイズ有効画素数7728^{H×} 4368^V(3,300万画素)の3次元積層 型 CMOS イメージセンサでは、1932^{H×} 4^Vの CDS および2 段サイクリック型と逐次比較型からなる3段 ADCによって、 消費電力3.0 W において階調12 ビット、画素出力レート7.96 Gpixel/sを得て、撮像速度240 fpsを達成している⁵⁰⁾.

バースト撮像型のイメージセンサでは、画素領域の上下 の領域に画素毎に128個のアナログメモリーを有する画素 ピッチ32µm,有効画素数400^H×250^V,最高撮像速度20 MfpsのCMOSイメージセンサにおいて、0.18µm 1P6Mテ クノロジに基づくプロセス開発により、開口率・電荷電圧 変換ゲイン(CG)・回路読出しゲインを増加させて従来比 で8倍の光感度を得るとともに、電源電圧を5.0Vから3.3V にすることで消費電力の半減が達成された⁵¹⁾.

また,高速電荷振分けを行う横電界制御型画素を有する 5×3のマルチアパーチャイメージセンサが報告された⁵²⁾. 符号化シャッタを適用して時間多重で蓄積された光信号に 対して逆問題を解いて時間分解することで,圧縮率47%に おける撮像速度200 Mfpsを達成している.アパーチャ毎の 有効画素数は64×108である.

広ダイナミックレンジ (DR) イメージセンサにおいては, 低照度側,高照度側それぞれにおいてDR拡大技術の進展 が見られた. 画素内に横型オーバフロー容量(LOFIC)を有するCMOS イメージセンサでは、FD容量を極小化する構造・プロセス 技術を導入してCGを247µV/e-に増加させるとともに、列出 力に複数のゲイン(16倍および1倍)を持つアンプを設けるこ とで、浮遊容量付加読出し時において、信号読出しRN0.47e-と飽和電荷数87ke, DR104 dBを達成している⁵³.

また,画素毎に印加電圧で増幅率を調整するpn接合アバ ランシェ増幅部を設けたCMOSイメージセンサが報告され た⁵⁴⁾.画素サイズ 3.8 μm角,画素数 1280^H×720^Vのチッ プにおいて光電子を10⁵倍に増加することで0.01 lux におけ るカラー画像を取得し,非アバランシェ増幅モードと合わ せてDR100 dBを達成している.

画素毎に6.5倍の感度差を設けた2種類のPDと,CGを調 整するために二つのFD間にスイッチを設けた画素サイズ 4.2 μm角,画素数1280^H×1080^Vの裏面照射型CMOSイメ ージセンサでは,3種類の蓄積期間を適用することで DR120 dBを達成している⁵⁵⁾.

また、有機光電変換薄膜を積層したCMOSイメージセン サにおいて、画素電極面積比、飽和電荷蓄積容量比にそれ ぞれ10倍の差を設けた2種類の画素を有するとともに、FD リセット時に取り込まれる熱雑音を低減する容量結合型ノ イズキャンセル回路を適用することで、65 nm 1P4 M プロ セスを用いた画素サイズ 6.0 μ m角、画素数 970 ^H × 550 ^V の チップにおいて信号読出しRN5.4 e-と飽和電荷数 600 ke-, DR123.8 dBを達成している ⁵⁶⁾.

広波長化に関しては,イメージセンサの分光感度帯域を 可視光帯域から紫外光帯域,近赤外光帯域へ拡大する技術 に加え,オンチップ分光機能を備える分光イメージセンサ 技術が提案された.

LOFIC CMOSイメージセンサでは、広光波長帯域・高 紫外光照射耐性PD技術,低FD容量技術を導入することで、 画素サイズ5.6 μ m角,有効画素数1280^H×960^Vのチップ において分光感度帯域190~1000 nm,CG240 μ V/e-,飽和 電荷数200 ke-を達成している⁵⁷⁾.

画素内にCG切替えスイッチを設けた画素サイズ11μm角, 画素数2048 × 2048の裏面照射型CMOSにおいて,分光感度 帯域250~1000 nmを得るとともに,反射防止膜の調整によ って最大量子効率を得る波長を400 nmおよび270 nmに作り 分けている.また,暗時RN 1.4 e-,飽和電荷数120 ke-, DR96 dBを達成している⁵⁸⁾.

マイクロバンプを用いて3次元積層された2層フォトダ イオード構造を有する画素サイズ3.8 µm角,有効画素数 4224^H×240^VのCMOSイメージセンサでは,赤外カットフ ィルタレスでベイヤー配列の6種類の画素で取得した信号 を用いてRGB画像とNIR画像を得ている⁵⁹⁾.

また、中心波長を作り分けたバンドパスフィルタをチップ 上に最小5.5 µm ピッチでライン、タイル、モザイク状に設 けたマルチハイパースペクトル CMOS イメージセンサでは、 ライン,タイル型では波長帯域600~1000 nmにおいて,そ れぞれ100および32波長,モザイク型では470~620 nmにお いて,16波長分の分光情報を得ることを達成している⁶⁰⁾.

以上,新規なプロセス技術や積層化技術の導入による速 度・ダイナミックレンジ・光波長帯域といったイメージセ ンサ基本性能の向上に関する動向が目立った.今後とも技 術の進展に伴い更なる性能向上が期待される. (黒田)

2.6 高機能化

セキュリティや車載,ロボティクスなどのさまざまな応 用に向けた,特徴のあるイメージセンサの開発が進められ ている.中でも,カメラから被写体までの距離や被写体の 形状を取得する3次元イメージセンサは,その用途の広さ から引き続き検討が盛んである.近赤外(IR)光を照射し, その反射情報から距離を計測するアクティブセンシングに は,光切断法,TOF(Time-of-Flight)法などがあるが,い ずれも撮像の時間解像度が測距の精度を決めるため,高速 で高感度なイメージセンサが求められている.

光切断法とは、走査したシート光の反射位置と光源の位置 から三角測量により距離を求めるものである.このための イメージセンサとして、画素配列の周辺におかれた検波回 路により、注目領域内の画素を並列に検波するものが検討 されている⁶¹⁾.距離1000 mmにおける測定誤差は10.7 mmで、 0.869 range maps/sで計測できる.

TOF法とは、変調された光を照射してからその反射光が検 出されるまでの時間から距離を求めるものである.このため のイメージセンサとして、SPAD (Single Photon Avalanche Diode)を用いた高感度なものが検討されている⁶²⁾.QVGA サイズであり、距離600mmにおける測定誤差RMSは38mm である.VOD (Vertical Overflow Drain)構造を用いた CMOSメージセンサが検討されており⁶³⁾、高速なグローバ ルシャッタを実現している.さらに、圧縮サンプリングを 用いたマルチアパーチャ型のイメージセンサが検討されて いる⁶⁴⁾.24mまでの範囲で、0.75mの分解能である.その 他にも、環境光の影響を抑制し、照射光の成分を強調する 機能を持ったものなどがあり、その精度向上に向けたさま ざまな工夫がなされている.

複数のイメージセンサを用いる,または一つのイメージ センサに対して複数のレンズを組合せ分割して撮像するカ メラの開発が進み,さまざまな応用が検討されている.距 離計測だけでなく,複数の画像情報を組合せることで,高 空間解像度,高フレームレート,広波長,高DR (Dynamic Range) 化などを実現し,撮像後のフォーカス調整も可能 である.例えば,TOMBO (Thin Observation Module by Bound Optics) と呼ばれるカメラでは,デンタルミラー, 内視鏡などの医用への応用が考えられている⁶⁵⁾.

通常のイメージセンサは,全画素が同じタイミングで撮 像を開始し終了するが,画素ごとに異なる動作をするイメ ージセンサの検討が進んでいる. 圧縮センシングを活用し て超高速に撮像するイメージセンサがその代表例である. カラーセンサのベイヤー配列のように、4種類の蓄積動作 パターンをブロック単位で繰り返して撮像することのでき るイメージセンサが検討されている⁶⁶. 後段の信号処理と 組合せることで、空間・時間解像度、DRを自由に変更し た画像を再構成することができる.

セキュリティ用のイメージセンサとして,RGBとIRを 同時に撮像できるイメージセンサの応用の検討が進んでい る.例えば,IR光を照射することで可視光が低照度の中で も画質の良いRGBカラー画像を取得するものが検討されて いる⁶⁷⁾.また,注目領域部分の空間解像度を落とす,DR を広げることのできるものが検討されている⁶⁸⁾.

近年,画素回路と周辺・処理回路を積層化するイメージ センサの実用化が進んでいる.イメージセンサチップ内で 処理と一体となった撮像を行うことで,新しい撮像方式に 基づいた大幅な性能向上や機能拡張が期待される. (浜本)

2.7 画像処理

カメラを用いた撮像において高品質な画像を取得するた めには、イメージセンサの性能向上だけでなく、イメージ センサで取得した画像を後処理することで、イメージセン サ単体の性能を超える高品質の画像を得ることができる.

例えば,撮影された画像の解像度を超えて,その画像に 含まれる高周波成分を復元する超解像技術は,現在も盛ん に研究が行われている.

中でも複数の画像を1枚に合成して高解像度化する方式 は広く用いられているが、反復演算の回数の削減が課題と なっていた.反復演算が不要で2枚の画像から1枚の高解 像な画像を再構成できる技術としてTPS (Time domain Phase compensated Sub-sampling) 法が知られているが、 影山らは画像にさまざまな動きが含まれる場合にも、TPS 法が適用可能であることを理論的に示すとともに、TPS法 の2次元拡張方式を提案した⁶⁹⁾.

一方,撮像後に画像処理を行うことを前提とした新しい センシング手法が数多く提案されている.これらは計算に よって初めて画像が生成されることから,コンピュテーシ ョナルフォトグラフィと総称されている.

小林らは、カメラを露光中に移動させることにより、物 体の動きの方向や大きさに依らず動きぼやけの復元が可能 であることを示した⁷⁰⁾.この撮像方法で任意の奥行きを持 つ物体の奥行きぼやけ復元が可能であることがすでに知ら れていたが、提案法では任意の奥行きに存在する任意の動 きを持つ物体の奥行きぼやけと動きぼやけを同時に復元す ることが可能となっている.

レンズに位相マスクを挿入して撮像した画像に画像復元 処理を施すことで,被写界深度が拡大するWavefront Codingという方式がある.佐藤らは,像面上でのPSF (Point Spread Function)の空間的な変換に着目し,復元に 用いるPSFを実際のPSFとの差分が小さくなるように変化 させることにより,広い被写界深度を保ちつつ,復元画像の画質を改善する手法を提案した⁷¹⁾.

園田らは,反射型液晶素子を用いて高速に絞り形状を変 更できる能動絞りカメラを提案した⁷²⁾.絞りの形状を変え ることで,カメラ撮像系のぼやけ関数を制御することがで き,ぼやけ復元や画像の奥行き推定,ライトフィールド取 得などに応用できる.透過型液晶ディスプレイ(LCD)を 用いた同様の試みはあったが,提案システムはより高い光 効率,絞り形状の高い自由度と高速な形状変更を実現して いる.

イメージセンサで取得した複数の情報を統合すること で,高品質な画像を取得する技術も研究されている.

山下らは、RGBと近赤外(NIR)の情報を単板のイメージ センサで取得できる撮像装置を用いて、取得したRGBと NIRの情報をもとに、補間処理とノイズ除去を同時に実現 し、鮮明なカラー画像を再構成する手法を示した⁷³⁾.

久下沼らは、CMOSイメージセンサを2次元アレイ状に 配置したマルチアパーチャカメラシステムにより撮影した 低SNR画像からデプスマップを推定し、視差補償した画像 の合成を行う手法を提案した⁷⁴⁾.確率的グラフィカルモデ ルを用いた大域的推定を行うことで、低照度下で撮影した 画像からでもデプスマップを推定することができている.

望月らは、マルチアパーチャ構造を持つCMOSイメージ センサを用いて、プラズマ発光のような瞬間的な現象を観 測するための高速撮像手法を提案した⁷⁵⁾.アパーチャ毎に 異なるパターンの符号化シャッタを適用し、信号電荷を画 素に時間多重して蓄積する.得られた時間多重画像とアパ ーチャ毎のシャッタパターンから逆問題を解くことで時間 分解した超高速画像を得ることができる.試作したセンサ により200 Mfpsでプラズマ発光を観測している.

山崎らは、単板イメージセンサを用いて時空間方向の露 光制御を行い、信号処理と組合せることで、高ダイナミッ クレンジ、高フレームレート、高S/Nの撮像を実現する手 法を提案した⁷⁶⁾. 試作したイメージセンサを用いて、10 dB のダイナミックレンジ拡大と3倍の高フレームレート化、 および高S/N化を達成している. (小室)

2.8 特殊機能

イメージセンサ上に集積化したナノ構造により偏光や色分 離・分光機能をしようとする研究が、さまざまなアプロー チで続けられている.以前から報告されているイメージセ ンサ画素上にワイヤ構造で偏光子を形成する偏光計測技術 では、*in vivo*(生体内)バイオイメージングを志向したデバ イス技術の報告⁷⁷⁾のほか、µTAS向けインライン偏光分析 装置などの応用研究例がみられている⁷⁸⁾.またIISW 2015に おける分光イメージング技術のセッションでは、垂直方向 のナノ構造を利用した特徴的な取組みが複数報告された. Anzagiraらはイメージセンサにおいて通常の吸収型フィル タを廃し、画素面に対して垂直方向の分散ブラッグ反射器

(DBR) 構造を採用することで、低照度でのカラーイメージ ングを実現する技術を提案している⁷⁹⁾.黒田らは、ライン センサにおいて画素ごとに最大4層(2ペア)のSiN_x/SiO₂積 層膜をつくりわけ、波長200~1100 nmの範囲を9種類の波 長レンジに分解して測定できるセンサを報告している⁸⁰⁾. さらに、垂直方向あるいは面内方向の干渉構造の一方だけ でなく, 面内・垂直方向のナノ構造を組合せた分光構造に ついても報告がなされている. Hongらは, 65 nm プロセス で3次元井桁状に組んだナノフォトニックフィルタ構造によ って,バイオ蛍光イメージングのためのフィルタを実現し た⁸¹⁾. Garciaらは、従来から報告されているワイヤグリッド 偏光子構造を、3層スタックフォトダイオード画素を備えた イメージセンサと組合せることで、分光と偏光分析機能を 同時に備えたイメージセンサを報告している82).研究開発 のみならず,産業応用の例として,ナノフォトニック構造 をイメージセンサ上に集積化することで実現した小型スペ クトロメータデバイスの市販例83)も現れており、今後の研 究開発と産業応用への展開が期待される.

バイオ応用のためのイメージング技術として,研究され てきたオンチップイメージングでは,蛍光フィルタ性能の 向上がなされるなど,バイオ計測技術としての有効性が実 証されつつある⁸⁴⁾.また1次計測対象がプロトンイオンで あるpHイメージセンサの高画素化,高性能化も実現され るとともに⁸⁵⁾,メディエータ膜を付加することによるアセ チルコリンやGABAといった各種のバイオ分子イメージン グの実証も進んでいる.イメージセンサベースのバイオ計 測テクノロジとして今後の研究展開に興味が持たれる.

バイオ蛍光イメージングでは,波長選択的フィルタ構造 によって励起光と蛍光を分離するのが一般的である.しか し,蛍光寿命より高速度な撮像技術があれば,励起光を停 止した後の蛍光寿命の間に撮像を行うことで,フィルタレ スの蛍光計測・イメージングが可能である.また蛍光寿命 そのものを測定したいという強いニーズもある.単一電子 アバランシェフォトダイオード (SPAD)を用いたアプロー チのほか,最適化されたポテンシャルプロファイルと複数 の転送ゲートによる振り分け転送方式の研究が進められて おり,IISW 2015で報告された時間分解能はそれぞれにつ いて約6.7ps⁸⁶⁾および約10ps⁸⁷⁾である.高い時間分解能に よる蛍光(寿命)計測センサ技術は,別項に述べたTOF法 による距離計測などとも合わせ,今後さらなる性能向上が 期待される.

なおIISW 2015において報告された特殊用途イメージセンサと応用システムについては、本誌2016年3月号特集記事(秋田氏著)に詳細を掲載. (徳田)

3. カメラ

3.1 放送用カメラ・高精細カメラ

放送衛星を用いた4K/8K放送について、2016年からの試

験放送,2018年からの実用放送が総務省のロードマップで 謳われており、その推進母体であるNexTVフォーラムや 電波産業会(ARIB)、各放送局やメーカなどで急速に準備 が進められている.これと歩調を合わせるかのように、上 位の民生機でも4K撮影が可能なものが発売されており、 高解像度化の流れは必然のように見える.

4K撮影が可能な業務用カメラは、ディジタルシネマが主 用途であったため、イメージセンサの光学サイズがSuper 35相当であり、放送用途としては、従来レンズの資産が生 かせない、被写界深度が浅いため中継等に不向き、などの 課題が指摘され、2015年になり放送を視野に入れたカメラ が複数報告された^{88)~91)}.いずれも、従来のHDTVと同様 の光学サイズである2/3インチ系のイメージセンサを使用 しており、文献⁸⁸⁾はHDTV用MOSイメージセンサを使用 したRGGB 4板式、そのほかについてはRGB3板式である. 特に3板式の場合、画素サイズが2.5 µm 程度となるため、 飽和電荷量の低下が懸念されるが、従来に比べセンサの低 ノイズ化が進捗しており、放送用として充分な性能を有す る(HDTV換算S/N 62 dB@F8)⁹⁰⁾仕様となっている.

一方でディジタルシネマ,放送共用のカメラの低廉化も 進み,カメラメーカ以外の機器メーカの参入も相次いでい る⁹²⁾⁹³⁾.これはA/Dコンバータを搭載したイメージセン サが直接ディジタル出力できるようになり,アナログ回路 の開発コストの低減が要因の一つであると想定される.

また小型軽量で,自分の体に装着してスポーツなどを楽 しみながら映像が撮影できる「アクションカメラ」と呼ばれ る分野の民生カメラでも,4K化⁹⁴⁾が進み,画質面では放 送用や業務用カメラには及ばないものの,コンテンツのヴ ァリエーションの拡大に貢献している.

8K撮影可能なカメラについても、市販モデルに関する報 告がされている⁹⁵⁾⁹⁶⁾.文献⁹⁵⁾では、8K単板カラーセンサ を使用しており、ユニット交換によりハードウェア構成が 容易に変更できるため、一旦6Kセンサなど低解像度モデ ルを購入したのち、センサユニットをアップデートし、8K 化することが可能である.文献⁹⁶⁾も同様に8K単板カラー センサを用いており、カメラヘッドのみの重量が2kgと、 過去の8Kカメラと比較して大幅な小型化を実現している.

市販されている8Kカメラの種類が充分ではないなか, 水平方向に8Kの画素数を有するセンサを用いた市販4Kカ メラを利用し,そのセンサ出力(Raw出力)をアップコン バートすることにより,8K相当の解像度を得るための信 号処理ユニットが開発されている⁹⁷⁾.

また試作レベルではあるが,Super 35相当サイズの CMOSセンサを用いて、13STOPのハイダイナミックレン ジと広色域化を実現したモデル⁹⁸⁾や放送現場での導入が進 んでいるモデル⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾についても開発が報告されている.さ らにベイヤー配列の単板カラーイメージセンサでも,デモ ザイク処理が不要な8Kイメージセンサとして133M画素撮 像素子¹⁰¹⁾と、この撮像素子を用いたカメラの試作が報告されている¹⁰²⁾.

4K/8K放送において特徴的なのは,解像度だけではなく, ITU-R BT.2020 (Rec. 2020) にて勧告化されている広色域, フレーム周波数の倍速化,さらに高ダイナミックレンジ (HDR) が対象となっていることである.

カメラの広色域化について, Rec. 2020はHDTV映像フ オーマットを規定しているITU-R BT.709の色域に比べ格 段に広いため,従来の3板式HDTVカメラ用分光プリズム とリニアマトリックス処理による色域変換では,色誤差が 多くなることが指摘されている.このため,専用のプリズ ムを設計し24色マクベスチャート撮像時の色差平均値とし て0.9を達成した例が報告されている¹⁰³⁾.

フレーム周波数の倍速(120 Hz)化について,4Kカメラで は先行して導入が進んでいる.他方8Kにおいてもイメージ センサの開発¹⁰⁴⁾が進められており,このセンサを用いたカ メラ開発の報告¹⁰⁵⁾がされている.さらにフレーム周波数が 4倍(240 Hz)のセンサ開発についても報告があり¹⁰⁶⁾,8Kハ イスピードカメラの開発が期待される.

放送におけるHDR化は,新たな光電変換関数をカメラに, またそれに対応した逆変換をディスプレイに導入すること で,カメラの信号処理であるニー処理で抑圧されていた高 輝度領域の再現を目指したものである.主に2種類の変換 関数が提案¹⁰⁷⁾¹⁰⁸⁾されているが,先行して規格化された関 数¹⁰⁸⁾を用いたHDR対応カメラ⁹¹⁾が開発されている.

RGBともに8K 解像度を有し(4:4:4),広色域,フレーム 周波数120 Hz, HDRといった放送規格のすべてのパラメー タにおいて最上位を実現した唯一の8Kカメラとして,文 献¹⁰⁹⁾の報告がある.

今後も,高精細撮像デバイスの小型化,高感度化,高フレームレート化等一層の性能の向上が期待される. (山下)

3.2 携帯電話用カメラ・ディジタルカメラ・ビデオカメラ 小型,薄型化が優先されるスマートフォンのカメラモジ ュールでは、イメージセンサのセルサイズを縮小すること で光学特性を維持しつつ低背化した¹¹⁰⁾.2014年~2015年 に発売されたフロントカメラの画素サイズは約1.12 µm, 1,200~2,300万画素が採用されている.採用の多い1,300万 1.12 µmの画素は、レンズ光学系モジュールのサイズを維 持した状態で4K-UHD画像撮影が可能な画素数であり、表 示デバイスの大画面高解像化にも応じた選択と推察され る.今後もスマートフォンにおける画素サイズの縮小は緩 やかに進み、解像度とモジュールの小型化を両立しつつ、 開発品では0.9 µm、製品としては1.0 µm前後の画素サイズ が採用される見込みである¹¹¹⁾.画素サイズの縮小、数の 増加は、解像度よりも画素分離方式の撮像面位相差¹¹²⁾¹¹³ として使用される傾向にある.

画素サイズの縮小は飽和状態であるが,画質改善,高解 像の画像を撮影するための技術には進展がみられる.光学 機構の改良,例えば,光学手ぶれ補正,オートフォーカス といったレンズに駆動機構を必要とする機能やF2.0前後の 明るいレンズが小型で薄いカメラモジュール内に実装され た.また,光学3倍ズームを薄いボディー内に内蔵した製 品¹¹⁴⁾も発表されており,今まではカメラ特有とされた技 術もスマートフォンに搭載され始めている.

オートフォーカス,距離情報取得の方式としては,従来 から採用されている遮光タイプの撮像面位相差を用いたも の,画素欠陥が発生しない画素分割方式の撮像面位相差に 加えて,TOF(光の到達時間計測)を用いた距離センサ¹¹⁵⁾, 奥行画像取得も可能な2眼カメラと言った新技術の採用が 活発である.

スマートフォンは,通信機能,DSP,GPUによる高速演 算処理機能を併せ持っている.高速演算処理は,フィルタ リングなど画質の改善の用途にとどまらず,動画や複数撮 影した画像から奥行情報の抽出,3次元像合成に代表され るコンピューテーショナルフォトグラフィー手法を具現化 する映像表現アプリケーション¹¹⁶⁾に用いられている.

ディジタルカメラでは、2012年にリフォーカスカメラ LYTROが発売され、最近では16個のカメラモジュールを搭 載し、最大5.200万画素、35~150mm相当のディジタルズ ーム、F1.2相当のほかしを生成可能なカメラが発売予定¹¹⁷⁾ である.今後、演算処理機能の高速化、低消費電力の進展 に伴い、より複雑で高度な処理がリアルタイムで実現可能 なインテリジェントカメラとしての進化も期待されるとこ ろであろう.

ディジタル一眼カメラでは、レンズ光学系を含めた入力 画像のMTFに対して撮像センサのナイキスト周波数が低 い場合にモアレ、偽色が発生する対策として光学ローパス フィルタを入れるが、ローパスフィルタを入れることによ り解像度も劣化するため、解決策が模索された.35mm光 学系カメラでは、2012年4月にニコンD800/800E(約3,600 万画素)が光学LPF有りとキャンセルを発売して以降, 2014年発売のD810(約3,600万画素)はLPFなしに統一さ れた. キヤノンは5Ds/5DsR(約5,000万画素)で,光学 LPF有りとキャンセル両機種を発売し、リコーイメージン グは露光中CMOSセンサを微小駆動させる方式で撮像セン サの解像度をコントロールするローパスセレクタを搭載し たPentax K-3を、ソニーはDSC-RX1RM2に液晶の偏光を 利用した光学式可変ローパスフィルタを、それぞれ世界初 搭載することで、この問題に対応している. 各社解像度と 相反するLPF有無問題へ異なる対応を行い,ピント位置精 度, 絞りによる回折, 機構ブレへの対応といった光学的要 素の改善とともに、高解像度化を進めている.

ビデオカメラでは4k-UHDの採用が本格的に始まり,高速 読出し,低消費電力,動画と静止画の同時撮影といった用 途に対応する技術開発が進められている.これらの課題に 対し,ソニーは裏面照射型センサに信号処理チップを積層 し、12ビット30fps時532mWと低消費電力で高速、1.3e-ms の低ノイズADC、データ圧縮、静止画と動画の2ストリー ム同時出力を可能とした1/1.7インチ、2,000万画素の裏面 照射積層センサを開発した¹¹⁸⁾. さらに、動体を撮影する 際にローリング歪みが発生する問題への対処として、長年 CMOSイメージセンサでの開発が待たれているグローバル シャッタを実現する発表も活発である.オリンパスは400 万個の微小バンプで3次元積層の受光層と信号処理層を接 続した、1,600万画素のセンサ¹¹⁹⁾を、パナソニックは有機 膜を使用した高ダイナミックレンジグローバルシャッタセ ンサを発表した¹²⁰⁾.

今後,2020年開催の東京オリンピックに向けて,8K動 画の開発,商品化が進められていくと思われ,ここにどの ような新しい技術が採用されていくか,各社の動向が気に なるところである. (綱井)

3.3 車載用カメラ・セキュリティ用カメラ・産業用カメラ 車載用カメラにおいては,先進運転支援システム (Advanced Driver Assistance System: ADAS)技術の進 展に伴い,近年活発な開発が進められている超高感度化イ メージセンサ(CMOSイメージセンサ,シングルフォトン アバランシェ増倍センサ(SPAD))と融合したTOF測距シ ステムの報告が増加している.

豊田中央研究所は、ADAS用高解像度光検知および測距 システム (High-resolution Light Detection and Ranging Systems: LIDAR) として、半導体レーザとポリゴンミラー からなるスキャン光源を用いたTOF測距システムを報告し ている¹²¹⁾. 200×96画素SPAD 2Dアレイを用いて、高感 度フォトンカウンティング検出動作信号処理を可能とする SoCを開発し、太陽光相当の背景光下で、測距範囲100 m、 測定誤差0.14%を実現したとしている. 類似の報告は多数あ り、ISSCC 2016においても衛星用途であるが、64×64画 素のSPADを用いた6kmまでの範囲で0.14%の精度を実現 するTOFシステムが報告されている¹²²⁾. レーザ光ビーム 広がり角をレンズ系で調整することにより、照射領域幅を 調節し、イメージングモードと長距離測距モードを切替え る.また、TOFシステムの評価指標の一般的な検討につい ては、文献¹²³⁾で報告されている.

車載用途3D物体検知システムにおいて,従来より,複 眼カメラ方式,単眼カメラ方式の優劣が議論されているが, 最新のトヨタの自動運転システムでは,前方監視カメラと しては複眼カメラの片方だけを単眼カメラとして使用して 白線検知に用いるという折衷案が報告されている¹²⁴⁾.

また、車載、監視、産業用すべてに広範な応用が期待されるカメラとして、超高速度(1,000万fps)撮像が可能なビデオカメラが東北大より報告されている¹²⁵⁾.本カメラに 搭載した高速CMOSイメージセンサは、画素数400×250, 画素サイズは32μm角であり、独自の高速電荷収集フォト ダイオード構造により、高速高感度を達成した.1画素あ たり128個のオンチップメモリーによりグローバルシャッ タ動作が可能であり、フルスキャンで500万fps,128フレー ム記録,ハーフスキャンで1,000万fps,256フレーム記録 が可能である.本カメラの応用範囲は、自動車衝突現象の 記録(車載,試験用),エンジンの燃料噴射の可視化(試験 解析用),プラズマ発光現象のモニタリング(産業用)と極 めて広い.

セキュリティ,車載用途として,RGB+IR一体型カメラ に対しては常に高い要望がある.オリンパスより,フォト ダイオードアレイを2層積層し,上部アレイで可視(RGB) 画像を取得,波長が長く,侵入長の長い近赤外光画像を下 部フォトダイオードアレイで撮像するCMOSイメージセン サが報告された¹²⁶⁾.上部へのIR成分と下部へのRGB成分 の混色の低減が課題となる可能性はあるものの,従来報告 されている単板(RGB+IR,RGB+White)カラーフィルタ方 式に比してIR専用画素を設けていない分,解像度は向上し ている.

セキュリティカメラ,産業用計測カメラにおいて,高解 像度化の要求も高まっている.これを実現する有力な方法 としてCMOSセンサの信号読出しの高速化,特にAD変換 時間の高速化が進んでいる.シングルスロープAD変換 (SS-ADC)のクロック周波数を単純に高めることで高速化 すると消費電力増加が課題である.複数のランプ信号を用 いた高速化が報告されたが,複数信号間の均一性が課題で あった.キヤノンは,これらの課題を解決する方法として, デュアルゲインアンプ型シングルスロープ列ADC (SSDG-ADC)を搭載したAPS-Hサイズ2.5億画素CMOSイメージ センサをISSCC 2016において報告した¹²⁷⁾.信号レベルに よって,列回路アンプのゲインを切替えることで,AD変 換時間を75%短縮し,ダイナミックレンジも6dB拡大して いる. (廣潮)

4. 不可視光撮影技術(特殊撮影技術)

4.1 赤外線

赤外線イメージセンサは、赤外線の検出方法により熱型 および量子型の2種類に大別される.熱型は赤外線エネル ギーによる検出部の温度変化を検出するセンサで、冷却機 構が不要であることから一般的な監視、温度計測用途向け に広く利用されている.一方の量子型では、赤外線のフォ トンエネルギーにより励起されたキャリヤを信号として検 出する.冷却機構が必要となるが、極めて高い感度を実現 できるため天体観測、軍事用途などで利用されている.近 年の赤外線検出器の開発動向の特徴としては、①検出波長 のマルチバンド化、②フレキシブル、③新材料・原理・ 構造の導入、の3点が見られる.以下それぞれについて、 紹介していく.

(1)検出波長のマルチバンド化

量子型においてはInAs/GaSb系のTypeII超格子による2波

長検出素子の研究開発が盛んとなっている.本構造では, 3~5μm帯および8~12μm帯の2バンド検出が可能とさ れている¹²⁸⁾.256×256素子で6.0×10¹⁰ cmHz^{1/2}W⁻¹¹²⁹⁾, 128×128素子で1.3×10¹¹ cmHz^{1/2}W⁻¹¹³⁰⁾が報告されてお り,今後も高感度化に向けた研究が進んでいくものと思わ れる.

熱型素子については、原理上は赤外線波長に対する選択 性を有しないが、赤外線吸収膜の工夫により波長選択性を 付与する試みがなされている.吸収膜上に金属の微細周期 構造を形成することで表面プラズモンを誘起し、波長選択 性が得られるとの報告^{131)~134)}やSiN/SiO積層構造による Siプロセス準拠の吸収膜¹³⁵⁾、画素毎に吸収膜を塗り分け る技術¹³⁶⁾が報告されている.

(2) フレキシブル化

ウェアラブルや生体計測の観点でさまざまなセンサ・エ レクトロニクスのフレキシブル化が進んでいる.赤外線セ ンサにおいては,熱型(焦電型)センサとしてポリフッ化ビ ニリデン(PVDF)系の有機焦電材料を樹脂基板上に成膜し たフレキシブルセンサが報告されている¹³⁷⁾¹³⁸⁾.しかしな がら,感度はセラミクス系材料と比較して劣るため,今後 も材料やプロセス改善を進める必要があると思われる.ま た,応用の観点からみるとサーモパイル型やボロメータ型 で高感度なセンサの開発も求められるだろう.

(3) 新材料・原理・構造の導入

熱型センサでは MEMS (Micro Electro-Mechanical System) 技術を応用した新しい検出素子や、グラフェンの ような新規材料を用いた素子が提案されている. 従来、赤 外線センサにおける MEMS 技術の適用は熱分離構造の形 成にあったが、近年提案されているデバイスでは、機械的 な振動や構造変化を赤外線検出に用いようとするものが見 られる¹³⁹⁾¹⁴⁰⁾.また、Si 以外の材料、例えば、AIN や GaN のような材料と MEMS 技術とを組合せた検出素子の提案 もなされている^{141)~143)}.

グラフェンの赤外線検出素子への応用範囲は広く,検出 素子のみならず電極,吸収膜,フィルタなど多岐にわたる. ここでは,グラフェンをボロメータ型センサへ応用した例 の紹介¹⁴⁴⁾にとどめるが,(2)項のフレキシブルセンサへの 応用など今後の展開が注目される.

いずれの技術も,赤外線検出素子の高機能・高感度・低 コスト化に繋がるものであり,これからのIoT時代におい て赤外線センサ利用の拡大に繋がるものと期待される.

(赤井)

4.2 X線

フィルムに代わりイメージセンサを用いてX線イメージ ングを行うディジタルラジオグラフィは、低照射線量(フ ィルムの数分の1)で撮影できること、現像が不要で画像の 確認が瞬時にできること、データを直接PCに保存できる こと、動画撮像ができること、と多くの特長を持つことか ら,近年急速に普及している.

X線イメージングに使用される検出器は、単結晶検出器, 化合物検出器など幅広い範囲にわたるが、中でもSi単結晶 を材料としたものは、最新の半導体技術を使った専用の CCD/CMOSイメージセンサが開発され、多くの種類が存 在している.

X線イメージングの主要アプリケーションは,胸部や歯 科用レントゲン撮像の医療診断,工業製品や食品の品質管 理における非破壊検査,空港の手荷物検査などである.こ のような用途では,硬X線と呼ばれる20keV以上のエネル ギーのX線を用い,物質に対するその高い透過性を利用し て,被写体を透視撮像する.X線検出器には,間接変換型 と呼ばれる撮像方式が使われており,その構成は,被写体 を透過したX線をシンチレータで受けて,波長550 nm付 近を中心とした可視光に変換した後,CCD/CMOS イメー ジセンサなどで可視光を電荷(電子)信号に変換して読出す ものである.

キーデバイスとなるシンチレータは、主流であったGOS (ガドリニウム系蛍光体シンチレータ)に代わり、CsI(ヨウ 化セシウム系シンチレータ)が多く用いられている.理由 として、CsIは柱状結晶であるため光の広がりが少なく解 像度が優れていること、厚膜化により検出効率を向上でき ることがあげられる.シンチレータとイメージセンサのカ ップリングは、FOP(Fiber Optic Plate)を介して行い、透 遇してくるX線をシールドし、イメージセンサの損傷、お よびランダムノイズの発生を抑制している.

X線検出器の性能に対する要求は,低被ばくで撮像するための高感度化,大きな被写体を撮像するための大面積化, 検査のスループットを向上するための高速化があげられる.

高感度化については、先に述べたシンチレータの検出効 率向上に加えて、カップリングのFOPをなくして、シンチ レータをイメージセンサに直接蒸着することで、シンチレ ーション光のロスを大幅に低減することができる.また、 イメージセンサに関して、CCDではTDI(Time Delay Integration)動作を利用して、高速かつ高感度の撮像を実 現しており、CMOSでは埋め込みフォトダイオード技術と、 各画素内に増幅器を内蔵した APS (Active Pixel Sensor)方 式を採用することで、高感度化と低ノイズ化を同時に実現 している.

大面積化については、a-Siを材料とする固体イメージセ ンサが開発されているが、信号の減衰に時間がかかるため、 残像の問題から高フレームレートの撮像は困難である. CCD/CMOSイメージセンサチップの大型化も進んでいる が、チップを製造するSiウェハのサイズを超えることはで きない、そこで複数のイメージセンサチップを高精度に近 接して配置する、タイリングが提案されている、センサチ ップ間の接合部では、感度が低下する場合があるが、ソフ トウェアによる画像補正により、継ぎ目のない大面積画像 を取得することが可能となっている.

高速化については,一般的なイメージセンサと同じく, 信号出力のマルチポート化,およびチップ内にA/Dコンバ ータを搭載してディジタル信号出力とする手法が取り入れ られている.

以上に述べた間接変換型のX線検出器に対し,CMOSな どの信号処理回路にa-Se,CdTe,PbI₂,HgI₂などの膜を積 層して,X線フォトンを直接電荷信号に変換して読出す方 式は,直接変換型と呼ばれる.間接変換型と比べて,感度, 解像度にメリットがあるが,現状ではコストが高い.直接 変換型の検出器の各画素において,入射したX線フォトン を個別に数えて,その総数を信号とするフォトンカウンテ ィング型の検出器が提案されている.一つのX線フォトン から生成される信号電荷量は,そのエネルギーに比例する ため,適当な閾値を設けて特定のエネルギーを弁別検出で きるというユニークな特長がある.各画素にプリアンプ, ディスクリミネータ,カウンタなどの回路を集積しなけれ ばならないが,半導体微細加工技術の進歩に伴い,55 µm の画素ピッチのものが報告されている¹⁴⁵⁾. (山本)

5. むすび

情報センシング分野におけるここ3年間の技術の進展を まとめた.幅広い分野でさまざまな進展があり、今後も継 続的な発展が大いに期待できる.情報センシング技術は、 今後さらに加速的に進化し、豊かで安心・安全な生活・環 境を提供し、未来を切り拓いていく原動力となることが期 待される. (2016年4月1日受付)

〔文献〕

- 江崎ほか: "湾曲CMOSイメージセンサ",映情学技報, 38, 37, pp.1-4 (2014)
- 3) 小林ほか: "像面位相差AFと撮像とを全画素で両立した低ノイズ・ 高感度CMOSイメージセンサ",映情学技報, 39, 35, pp.1-4 (2015)
- A. Morimitsu, et al.: "A 4M pixel full-PDAF CMOS image sensor with 1.58µm 2×1 On-Chip Micro-Split-Lens technology", 映情学技 報, 39, 36, pp.5-8 (2015)
- 5) 沖野ほか: "広ダイナミックレンジ・低ノイズ有機CMOSイメージセンサ",映情学技報, 38, 15, pp.1-4 (2014)
- 6) A. Nishimura, et al.: "An Over 120dB Simultaneous-Capture Wide-Dynamic-Range 1.6e- Ultra-Low-Reset-Noise Organic-Photoconductive-Film CMOS Image Sensor", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers. pp.110-111 (Feb. 2016)
- S. Shishido et al.: "210ke- Saturation Signal 3µm-Pixel Variable-Sensitivity Global-Shutter Organic Photoconductive Image Sensor for Motion capture", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers. pp.112-113 (Feb. 2016)
- S. Imura, et al.: "High Sensitivity Image Sensors Overlaid with Thin-Film Gallium Oxide/Crystalline Selenium Heterojunction Photodiodes", IEEE Trans. on Electron Devices, 63, 1, pp.86-91 (2016)
- 9) S. Imura, et al.: "Stacked Image Sensor Using Chlorine-doped Crystalline Selenium Photo-conversion Layer Composed of Size-controlled Polycrystalline Particles", 2015 IEDM Tech. Dig., pp.30.7.1-30.7.4 (Dec. 2015)

- 10) K. Miyakawa et al: "High Sensitivity CMOS Image Sensor Overlaid with Ga₂O₃/CIGS Heterojunction Photodiode", 2016 IS&T International Symposium on Electronic Imaging (Feb. 2016)
- 11) Y. Kurokawa et al.: "High-Sensitivity Image Sensor with Stacked Structure Comprising Crystalline Selenium Photoconductor, Crystalline OS FET and CMOS FET", Proc. 2015 IISW, pp.348-351 (June 2015)
- 12) H. Seo et al.: "Stacked Organic Photoconductive Films and Thin-Film Transistor Circuits Separated by Thin Silicon Nitride for a Color Image Sensor", 2014 IEEE Sensors, pp.1672-1675 (Nov. 2014)
- 13) T. Takagi et al.: "Fabrication of Image Sensor with Organic Photoconductive Films by Stacking Red/Green Component and Blue Component", 2016 IS&T International Symposium on Electronic Imaging (Feb. 2016)
- 14) J. Aoki et al.: "A rolling shutter distortion free 3D stacked image sensor with -160dB parasitic light sensitivity in-pixel storage node", 2013 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.482-483 (Feb. 2013)
- 15) T. Arai et al.: "A 1.1μm 33Mpixel 240fps 3D-Stacked CMOS Image Sensor with 3-Stage Cyclic-Based Analog-to-Digital Converters", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.126-127 (Feb. 2016)
- 16) M. Goto et al.: "Pixel-Parallel 3-D Integrated CMOS Image Sensors with Pulse Frequency Modulation A/D Converters Developed by Direct Bonding of SOI Layers", IEEE Trans. on Electron Devices, 62, 11, pp.3530-3535 (2015)
- Y. Lim, et al.: "A l.l e- Temporal Noise 1/3.2-inch 8Mpixel CMOS Image Sensor using Pseudo-Multiple Sampling", 2010 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.396-397 (Feb. 2010)
- 18) Y. Chae, et al: "A 2.1Mpixel 120
frame/s CMOS image sensor with column-parallel $\Delta\Sigma$ ADC architecture", 2010
 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.394-395 (Feb. 2010)
- 19) M.W. Seo, et al: "A Low-Noise High Intrascene Dynamic Range CMOS Image Sensor with a 13 to 19b Variable-Resolution Column-Parallel Folding-Integration/Cyclic ADC", IEEE Journal of Solid-State Circuits, 47, 1, pp 272-283 (2012)
- 20) Y. Shinozuka, et al: "A single-slope based low-noise ADC with inputsignal-dependent multiple sampling scheme for CMOS image sensors", Proc. 2015 ISCAS, pp.357-360 (May 2015)
- 21) S.F. Yeh, et al: "A 0.66e_{rms} temporal-readout-noise 3D-stacked CMOS image sensor with conditional correlated multiple sampling (CCMS) technique", 2015 Symp. VLSI Circuits Dig. Tech Papers, pp.84-85 (June 2015)
- 22) M.K. Kim, et al: "A Fast Multiple Sampling Method for Low-Noise CMOS Image Sensors with Column-Parallel 12-bit SAR ADCs", Journal of Sensors, 16, 17. pp 2-14 (2016)
- 23) H. Wakabayashi, et al: "A 1/1.7-inch 20Mpixel Back-Illuminated Stacked CMOS Image Sensor with Parallel Multiple Sampling", Proc. 2015 IISW, pp.44-47 (June 2015)

24) S. Wakashima, et al: "Analysis of pixel gain and linearity of CMOS image sensor using floating capacitor load readout operation", Proc. 2015 SPIE 9403, Image Sensors and Imaging Systems, pp.94030E-1-10 (Mar. 2015)

 $25)\,http://www.ovt.com/news/presskit.php?ID{=}170$

26) https://news.samsung.com/global/samsung-announces-mass-production-of-industrys-first-mobile-image-sensor-with-1-0%CE%BCm-pixels 27) http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201602/16-013/

- 28) V.C. Venezia, et al.: "Stack chip technology: New Direction for CMOS Imagers", Proc. 2015 IISW, pp.36-39 (June 2015)
- 29) J. Ahn, et al.: "A 1/4-inch 8Mpixel CMOS Image Sensor with 3D Backside-Illuminated 1.12μm Pixel with Front-side Deep-Trench Isolation and Vertical Transfer Gate", 2014 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.124-125 (Feb. 2014)
- 30) M. Takase et al.: "First Demonstration of 0.9μm Pixel Global Shutter Operation by Novel Charge Control in Organic Photoconductive Film", 2015 IEDM Tech. Dig., pp.775-778 (Dec. 2015)
- 31)R. Funatsu, et al.: "133Mpixel 60fps CMOS Image Sensor with 32-Column Shared High-Speed Column-Parallel SAR ADCs", 2015 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.112-113 (Feb. 2015)

- 32)H. Totsuka et al.: "An APS-H-Size 250Mpixel CMOS Image Sensor Using Column Single-Slope ADCs with Dual-Gain Amplifiers", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.116-117 (Feb. 2016)
- 33) http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200806/08-069/index.html
- 34) V.C. Venezia et al.: "Stack Chip Technology: A New Direction for CMOS Imagers", Proc. 2015 IISW, pp.36-39 (June 2015)
- 35)"Samsung Heralds a New Era of Photography with the Samsung NX1", http://www.samsungmobilepress.com/2014/09/15/Samsung-Heralds-a-New-Era-of-Photography-with-the-Samsung-NX1-1
- 36) http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201506/15-0626B/
- 37)K. Nishimura et al.: "An Over 120dB Simultaneous-Capture Wide-Dynamic-Range 1.6e- Ultra-Low-Reset-Noise Organic-Photoconductive-Film CMOS Image Sensor", 2015 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.110-111 (Feb. 2015)
- 38) http://www.invisage.com/news
- 39) T. Kondo et al.: "A 3D stacked CMOS image sensor with 16Mpixel global-shutter mode and 2Mpixel 10000fps mode using 4 million interconnections", 2015 Symp. VLSI Circuits. Digest of Technical Papers, pp.4-5 (June 2015)
- 40) S. Nasuno et al.: "A CMOS Image Sensor with 240 $\mu V/e$ - Conversion Gain, 200 ke- Full Well capacity and 190-1000nm Spectral Response", Proc. 2015 IISW, pp.312-315 (June 2015)
- 41) http://cweb.canon.jp/newsrelease/2015-07/pr-me20fsh.html
- 42) E. Fossum: "Application of Photon Statistics to the Quanta Image Sensor", Proc. 2013 IISW, pp.313-316 (June 2013)
- 43) F. Kusuhara et al.: "Analysis and reduction of Floating Diffusion Capacitance Components of CMOS Image Sensor for Photon-Countable Sensitivity", Proc. 2015 IISW, pp.120-123 (June 2015)
- 44) J. Ma et al.: "Quanta Image Sensor Jot with Sub 0.3e- r.m.s. Read Noise and Photon Counting Capability", IEEE Electron Device Letters, 36, 9, pp.926-928 (Sep. 2015)
- 45)B. Mamdy et al.: "A low-noise, P-type, vertically-pinned and back-side illuminated pixel structure for image sensor applications", Proc. 2015 IISW, pp.361-364 (June 2015)
- 46) A. Boukhayma et al.: "A 0.4e-rms Temporal Readout Noise, $7.5\,\mu{\rm m}$ pitch and a 66% fill factor Pixel for Low Light CMOS Image Sensors", Proc. 2015 IISW, pp.365-368 (June 2015)
- 47)Q. Yao et al.: "CMOS image sensor reaching 0.34e-RMS read noise by inversion-accumulation cycling", Proc. 2015 IISW, pp.369-372 (June 2015)
- 48) M.W. Seo et al.: "A 0.27e-rms Read Noise 220 μV/e- Conversion Gain Reset-Gate-Less CMOS Image Sensor with 0.11 μm CIS Process", IEEE Electron Device Letters, 36, 12, pp.1344-1347 (2015)
- 49) R. Funatsu et al.: "133Mpixel 60fps CMOS image sensor with 32-column shared high-speed column-parallel SAR ADCs", 2015 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.112-113 (Feb. 2015)
- 50) T. Arai et al.: "A 1.1 μm 33Mpixel 240fps 3D-Stacked CMOS Image Sensor with 3-Stage Cyclic-Based Analog-to-Digital Converters", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.126-127 (Feb. 2016)
- 51)S. Sugawa et al.: "A 20Mfps Global Shutter CMOS Image Sensor with Improved Sensitivity and Power Consumption", Proc. 2015 IISW, pp.166-169 (June 2015)
- 52)F. Mochizuki et al.: "Single-Shot 200Mfps 5× 3-Aperture Compressive CMOS Imager", 2015 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.116-117 (Feb. 2015)
- 53)S. Wakashima et al.: "A Linear Response Single Exposure CMOS Image Sensor with 0.5e- Readout Noise and 76ke- Full Well Capacity", 2015 Symp. VLSI Circuits, Dig. Tech. Papers, pp.C88-C89 (June 2015)
- 54)M. Mori et al.: "A 1280 × 720 Single-Photon-Detecting Image Sensor with 100dB Dynamic Range Using a Sensitivity-Boosting Technique", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.120-121 (Feb. 2016)
- 55) T. Willassen et al.: "A 1280×1080
4.2 μm Split-diode Pixel HDR Sensor in 110nm BSI CMOS Process", Proc. 2015 II
SW, pp.377-380 (June 2015)
- 56) K. Nishimura et al.: "An Over 120dB Simultaneous-Capture Wide-Dynamic-Range 1.6e- Ultra-Low-Reset-Noise Organic-Photoconductive-

Film CMOS Image Sensor", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.110-111 (Feb. 2016)

- 57) S. Nasuno et al.: "A CMOS Image Sensor with 240 $\mu V/e\text{-}$ Conversion Gain, 200 ke- Full Well Capacity and 190-1000nm Spectral Response", Proc. 2015 IISW, pp.312-315 (June 2015)
- 58)X. Wang et al.: "A 4M, 1.4e- noise, 96dB dynamic range, back-side illuminated CMOS image sensor", Proc. 2015 IISW, pp.316-319 (June 2015)
- 59) Y. Takemoto et al.: "Multi-storied photodiode CMOS image sensor for multiband imaging with 3D technology", 2014 IEDM Tech. Dig., pp.771-774 (Dec. 2015)
- 60) A. Lambrechts et al.: "A CMOS-compatible, integrated approach to hyper- and multispectral imaging", 2014 IEDM Tech. Dig., pp.261-264 (Dec. 2014)
- 61)松島ほか: "注目領域画素並列検波による3次元形状取得向けCMOS イメージセンサ",映情学誌, 69,3, pp.J80-J85 (2015)
- 62)N.A.W. Dutton et al.: "Oversampled ITOF Imaging Techniques using SPAD-based Quanta Image Sensors", Proc. 2015 IISW, pp.170-173 (June 2015)
- 63) E. Tadmor et al.: "A High QE, Fast Shuttered CMOS Image Sensor with a Vertical Overflow Drain Shutter Mechanism", Proc. 2015 IISW, pp.174-177 (June 2015)
- 64) F. Mochizuki et al.: "A multi-aperture compressive time-of-flight CMOS imager for pixel-wise coarse histogram acquisition", Proc. 2015 IISW, pp.178-181 (June 2015)
- 65)香川ほか: "小型複眼カメラの医用応用",映情学技報, 38, 23, pp.49-52 (2014)
- 66)H.Tabata et al.: "Spatiotemporally Varying Exposure Imaging for High Quality Image Reconstruction", Image sensor workshop (IISW'15), 7.14 (June 2015)
- 67) H.Yamashita et al.: "Enhancing Low-light Color Images using an RBG-NIR Sensor", IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP), pp.119-121 (Dec. 2015)
- 68) R. Carmona-Galán et al.: "Automatic DR and spatial sampling rate adaptation for secure and privacy- aware ROI tracking based on focal-plane image processing", Proc. 2015 IISW, pp.397-400 (June 2015)
- 69)影山ほか: "画像の位相シフトを利用した超解像再構成処理の適用可 能性と2次元拡張に関する検討",映情学誌, 68, 6, pp.J247-J251 (2014)
- 70)小林ほか: "IPSFに基づく動きほけと奥行きほけの同時復元",映情 学誌, 68, 9, pp.J399-J407 (2014)
- 71) 佐藤ほか: "コマ収差による3次位相変化を用いたWavefront Coding におけるPSF 補正に基づく復元画像の画質改善",映情学誌, 69.3, pp.J91-J97 (2015)
- 72) 園田ほか: "さまざまな符号化撮像を実現する能動絞りカメラ",日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2015講演予稿集, 30aES15 (Oct. 2015)
- 73)山下ほか: "RGB-NIR単板イメージセンサを用いた低照度カラー画 像の画質改善",映情学技報, 39, 17, pp.17-20 (2015)
- 74) 久下沼ほか: "低照度マルチアパーチャ画像からのデプスマップ推定",映情学技報, 39, 17, pp.5-8 (2015)
- 75) 望月ほか: "画素内圧縮型マルチアパーチャ超高速イメージセンサによる 200Mfps バースト撮影",映情学技報, 39, 16, pp.45-48 (2014)
- 76)山崎ほか: "時空間の露光制御機能を持つイメージセンサと画質向上のための撮像・処理方式",映情学誌, 69, 3, pp.J106-J112 (2015)
- 77) T. York, et al.: "220 × 128 120mW 60frames/s Current Mode Polarization Imager for in Vivo Optical Neural Recording", Proc. 2014 ISCAS, pp.1849-1852 (June 2014)
- 78) T. Tokuda, et al.: "CMOS sensor-based palm-sized in-line optical analysis device for microchemistry systems", Electronics Letters, 50, 17, pp.1222-1224 (2014)
- 79)L. Anzagira, et al.: "Two Layer Image Sensor Pixel Concept for Enhanced Low Light Color Imaging", Proc. 2015 IISW, pp.70-73 (June 2015)

- 80) R. Kuroda, et al.: "A 80% QE High Readout Speed 1024 Pixel Linear Photodiode Array for UV-VIS-NIR Spectroscopy", Proc. 2015 IISW, pp.78-81 (June 2015)
- 81)L. Hong, et al.: "A Fully Integrated CMOS Fluorescence Biosensor with on-chip Nanophotonic Filter", Proc. of 2015 Symp. VLSI Circuits, pp.C206-C207 (June 2015)
- 82) M. Gracia, et al.: "A 1300 × 800, 700mW, 30fps Spectral Polarization Imager", Proc. 2015 ISCAS, pp.1106-1109 (June 2015)
- 83) http://www.nanolambda.net/
- 84) T. Kobayashi, et al.: "Optical communication with brain cells by means of an implanted duplex micro-device with optogenetics and Ca2⁺ fluoroimaging", Scientific Reports 6, 21247 (2016)
- 85)H. Nakazawa, et al.: "High-Sensitivity Charge-Transfer-Type pH Sensor with Quasi-Signal Removal Structure", IEEE Trans. on Electron Devices, 61, 1, pp.136-140 (2015)
- 86)L. Parmesan, et al.: "A 256 × 256 SPAD array with in-pixel Time to Amplitude Conversion for Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy", Proc. 2015 IISW, pp.296-299 (June 2015)
- 87) M.W. Seo, et al.: "Time-resolved imaging device with high-speed modulators for fluorescence lifetime measurement system", Proc. 2015 IISW, pp.251-254 (June 2015)
- 88) http://www.hitachi-kokusai.co.jp/products/broadcast/camera/skuhd4000/index.html
- 89) http://www.ikegami.co.jp/news/detail.html?news_id=985
- 90) https://pro.sony.com/bbsc/ssr/show-4kliveproduction/resource.latest.bbsccms-assets-show-4kliveproduction-hdc4300landingpage.shtml
- 91)K. Weber : "4K, HDR and Further Image Enhancements for Live Image Acquisition", SMPTE Annual Technical Conference and Exhibition 2015 (2015)
- $92)\,https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/cinemacameras$
- 93) https://www.aja.com/jp/products/cion
- 94) 例えば, http://shop.gopro.com/APAC/cameras
- 95) http://www.red.com/news/post-nab-2015-recap
- 96) http://www.astrodesign.co.jp/japanese/product/ah-4800
- 97)K. Ichikawa et al.: "Development of Super Hi-Vision (8K) Baseband Processor Unit BPU-8000", SMPTE Annual Technical Conference and Exhibition 2014 (2014)
- 98) http://web.canon.jp/pressrelease/2015/p2015sep08j02.html
- 99) http://www.hitachi-kokusai.co.jp/news/2015/news150406.html
- 100) http://www.ikegami.co.jp/news/detail.html?news_id=907
- 101)R. Funatsu, et al.: "A 133-Mpixel 60-fps CMOS Image Sensor with 32-Column Shared High-Speed Column Parallel SAR-ADCs", 2015 ISSCC Dig. Tech. Papers, 6.2 (Feb. 2015)
- 102) T. Nakamura, et al.: "Development of an 8K full-resolution singlechip image acquisition system", 2016 IS&T International Symposium on Electronic Imaging, IMSE-271 (Feb. 2016)
- 103) 添野ほか: "スーパーハイビジョンカメラの広色域化",2013 映情学 年大講演予稿集,10-5-1 (2013)
- 104)安江ほか: "DMOSキャパシタを用いた3,300万画素, 120Hz, 14ビ ットCMOSイメージセンサの開発",映情学技報, 39, 35, pp.25-28 (2015)
- 105)K. Kitamura, et al.: "Full-specification 8K Super Hi-Vision camera", 1st International Conference on Advanced Imaging (ICAI 2015), T304-02, pp.366-369 (2015)
- 106) T. Arai et al.: "1.1μm 33Mpixel 240fps 3D-Stacked CMOS Image Sensor with 3-Stage Cyclic Based Analog-Digital Converters", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, 6.9, pp.126-127 (Feb. 2016)
- 107) ARIB STD-B67: "ESSENTIAL PARAMETER VALUES FOR THE EXTENDED IMAGE DYNAMIC RANGE TELEVISION (EIDRTV) SYSTEM FOR PROGRAMME PRODUCTION" (2015)
- 108)SMPTE ST 2084: "High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering. Reference Displays" (2014)
- 109)K. Kitamura et al.: "Full-specification 8K Camera System", Proc. NAB 2016 (2016)
- 110) 中條: "スマートフォンが要求する超低背カメラモジュール-カメ ラモジュールの超低背化を実現するための要素技術-",映情学技報, 37, 40, pp.49-54 (2013)

- 111)小林: "スマートフォン向けイメージセンサに望むこと~画素特性 とその改善~",映情学技報, 39, 35, pp.21-24 (2015)
- 112)小林ほか: "像面位相差AFと撮像とを全画素で両立した低ノイズ・高感度CMOSイメージセンサ",映情学技報, 39, 35, pp.1-4 (2015)
- 113) A. Morimitsu et al.: "A 4M pixel fill-PDAF CMOS Image Sensor with 1.58µm 2x1 On-chip Micro-split-lens Technology", 映情学技報, 39, 35, pp.5-8 (2015)
- 114) ASUS HOYA: ZenFone Zoom (Jan. 2016)
- 115) Google: Project Tango (June 2015)
- 116)P. Ondrúška et al.: "Mobile Fusion Real-time Volumetric Surface Reconstruction and Dense Tracking on Mobile Phones", IEEE Trans. Vis Computer Graph., 21, 11, pp.1251-1258 (2015)
- 117) Light L16, https://light.co/ (Oct. 2015)
- 118) 貝沼ほか: "高速・高画質・高機能を有する1/1.7型2,000万画素積 層型CMOSイメージセンサ",映情学技報, 39, 16, pp.1-4 (2015)
- 119)近藤はか: "1,600万画素グローバルシャッタモード搭載400万マイクロバンプ接続積層イメージセンサ",映情学技報, 39, 35, pp.9-12 (2015)
- 120)S. Shishido et al.: "210ke- Saturation Signal 3µm-Pixel Variable-Sensitivity Global-Shutter Organic Photoconductive Image Sensor for Motion Capture", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.112-113 (Feb. 2016)
- 121)C. Niclass, et. al.: "A 0.18 μm CMOS SoC for a 100-m-Range 10-Frame/s 200 × 96-Pixel Time-of-Flight Depth Sensor", IEEE Journal of Solid-State Circuits, 49, 1, pp.315-329 (2014)
- 122) M. Perenzoni, et. al.: "A 64×64-Pixel Digital Silicon Photomultiplier Direct ToF Sensor with 100MPhotons/s/pixel Background Rejection and Imaging/Altimeter Mode with 0.14% Precision up to 6km for Spacecraft Navigation and Landing", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.118-119 (Feb. 2016)
- 123) J. Kostamovaara, et. al.: "On Laser Ranging Based on High-Speed/Energy Laser Diode Pulses and Single-Photon Detection Techniques", IEEE Photonics Journal, 7, 2, 7800215 (2015)
- 124) 日経 Automotive, 2015.12, pp.54-59 (2015)
- 125) 鈴木ほか: "常用光感度ISO16000 に高めた最高撮像速度1,000万コ マ/秒の高速度ビデオカメラシステムによる高速現象の可視化",映 情学技報,40,12, pp.25-28 (2016)
- 126)竹本ほか: "3次元積層技術を用いた積層フォトダイオードCMOS イメージセンサによるマルチバンドイメージング",映情学技報, 40, 12, pp.5-8 (2016)
- 127)H. Totsuya et. al.: "An APS-H-Size 250MPixel CMOS Image Sensor Using Column Single-Slope ADC with Dual-Gain Amplifiers", 2016 ISSCC Dig. Tech. Papers, pp.116-117 (2016)
- 128)R. Rehm, et al.: "InAs/GaSb superlattice infrared detectors", Infrared Physics & Technology, 70, pp.87-92 (2015)
- 129) Z.Z. Bai, et al.: "320 \times 256 dual-color mid-wavelength infrared InAs/GaSb superlattice focal plane arrays", Journal of Infrared and Millimeter Waves, **34**, pp.716-720 (2015)
- 130)X. Chen: "Short-wavelength infrared focal plane array based on type-II InAs/GaSb superlattice", Optical and Quantum Electronics, 48, 84, pp.1-8 (2016)
- 131)S. Ogawa, et al.: "Polarization selective uncooled infrared sensor using an asymmetric two-dimensional plasmonic absorber", Proceedings of SPIE, 9070, 90701T (2014)
- 132)S. Ogawa, et al.: "Three-dimensional plasmonic metamaterial absorbers for high-performance wavelength selective uncooled infrared sensors", Proceedings of SPIE, 9070, 90701Y (2014)
- 133)S. Ogawa, et al.: "Polarization selective uncooled infrared sensor using a one-dimensional plasmonic grating absorber", Proceedings of SPIE, 9451, 94511K (2015)
- 134) Y. Li, et al.: "Plasmonic induced triple-band absorber for sensor application", Optics Express, 23, pp.17607-17612 (2015)
- 135)大石はか: "γAl₂O₃/Si 基板上の結晶配向PZT 薄膜赤外線センサと CMOS 回路インテグレーション",映情学技報, 39. 5. pp.27-34 (2015)

- 136)M. Oussalah, et al.: "Multispectral Thin Film Coating on Infrared Detector", Proceedings of SPIE, 9627, 96271W (2015)
- 137) A.K. Batra, et al.: "Pyroelectric Properties of PVDF:MWCNT Nanocomposite Film for Uncooled Infrared Detectors and Medical Applications", Integrated Ferroelectrics, 158, pp.98-107 (2014)
- 138)L. Tian, et al.: "The performance of the free-standing P (VDF-TrFE) infrared detector", Journal of Infrared and Millimeter Waves, 34, pp.654-657 (2015)
- 139) U. Adiyan: "A 35-µm Pitch IR Thermo-Mechanical MEMS Sensor with AC-Coupled Optical Readout", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 21, 2701306 (2015)
- 140) J.Q. Han, et l.: "Resonant IR detectors based on microbridge resonators electrothermally excited and piezoresistively detected using polysilicon resistors of negative TCR", Journal of Infrared and Millimeter Waves, 34, pp.134-139 (2015)
- 141)K. Yamamoto, et al.: "Pyroelectric aluminum nitride micro electromechanical systems infrared sensor with wavelength- selective infrared absorber", Applied Physics Letters, 104, p.111111 (2014)
- 142) W.C. Ang, et al.: "Uncooled resonant infrared detector based on aluminum nitride piezoelectric film through charge generations and lattice absorptions", Applied Physics Letters, 104, 201110 (2014)
- 143) V.J. Gokhale, et al.: "Uncooled Infrared Detectors Using Gallium Nitride on Silicon Micromechanical Resonators", Journal of Microelectromechanical Systems, 23, 803-810 (2014)
- 144)B.S. Karasik, et al.: "Monolayer graphene bolometer as a sensitive far-IR detector", Proceedings of SPIE, 9153, 915309 (2014)
- 145) R. Ballabriga: "The Design and Implementation in $0.13\,\mu m$ CMOS of an Algorithm Permitting Spectroscopic Imaging with High Spatial Resolution for Hybrid Pixel Detectors, CERN-THESIS-2010-055 (2009)



須川 成利 1982年,東京工業大学大学院理工学研 究科修士課程修了.同年,キヤノン(株)入社.1996年, 東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了.1999年, 東北大学大学院工学研究科助教授.2002年,同教授. CMOSイメージセンサ等の開発に従事.博士(工学). 正会員.



 ***</li



10.07 将之 2000年,北海道大学大学院電子情報工 学専攻博士課程修了.2000年,大日本印刷株式会社半導 体製品研究所.2004年,北海道大学准教授.信号処理ア ルゴリズムとその集積回路化の研究,およびCMOSイメ ージセンサの高機能化の研究に従事.博士(工学).



(佐藤 俊明 1984年,東京理科大学大学院理学研究 科修士課程修了.同年,キヤノン(株)入社.フォトセ ンサ等の機能デバイスおよびアナログ信号処理回路の設 計・開発に従事.2008年,Aptina Imaging(現オン・セ ミコンダクター)入社.CMOSイメージセンサの設計・ 開発に従事.



小林 昌弘 2004年,東京工業大学大学院電気電子 工学専攻修士課程修了.同年,キヤノン(株)入社.以 来,CMOSイメージセンサの設計,研究開発に従事.現 在,同社半導体デバイス要素開発センター主任研究員. 正会員.



 第二 理人 2010年,東北大学大学院工学研究科博 土課程修了.2007年~2010年,日本学術振興会特別研 究員(DC1).2010年,東北大学大学院工学研究科助教.
 2014年,同准教授.低ノイズトランジスタ技術,高機能
 CMOSイメージセンサ等の研究に従事.博士(工学).正 会員



は近もと 降之 1992年,東京理科大学工学部電気工学 科卒業.1997年,東京大学大学院工学研究科電気工学専 攻博士課程修了.現在,東京理科大学工学部電気工学科 教授.画像情報処理,コンピュテーショナルセンサ等の 研究に従事.工学博士.正会員.



小室 2001年,東京大学大学院工学系研究科 計数工学専攻博士課程修了.同年,科学技術振興事業団 研究員.2002年,東京大学大学院情報理工学系研究科シ ステム情報学専攻助手.2005年,同講師.2011年,埼玉 大学大学院理工学研究科数理電子情報部門准教授.高速 画像処理とその応用に関する研究に従事.博士(工学). 正会員.



(徳田 呉) 1998年,京都大学大学院工学研究科博 士後期課程修了.1998年,日本学術振興会特別研究員 (PD).1999年,奈良先端科学技術大学院大学物質創成 科学研究科助手.2008年,同大学准教授.半導体フォト ニクスデバイス,特にバイオイメージングデバイス,ニ ューロエレクトロニクスデバイスの研究に従事.博士 (工学).正会員.





綱井 史郎 1990年,武蔵工業大学大学院工学研究 科修士課程修了.同年,日本電気(株)入社.以来,イ メージセンサの設計開発に従事,2008年(株)ニコン入 社.イメージセンサ,カメラの開発等に従事.正会員



廣瀬 裕 1987年,東京大学大学院工学系研究科 修士課程修了.1995年,Princeton大学大学院Ph.D.取得. 1996年,日本テキサス・インスツルメンツ(株)入社. 2001年,松下電器産業(現パナソニック)(株)入社.半 導体デバイス,イメージセンサ開発に従事.正会員.



化物・強誘電体薄膜成長およびそれらの薄膜を用いたセンサ・アクチュエ ータとシリコンデバイスとの融合に関する研究に従事.博士(工学).



***** 山本 洋夫 1994年,千葉大学工学部電気電子工学 科卒業.同年,浜松ホトニクス(株)入社.固体事業部 にて,CMOSイメージセンサ,X線フラットパネルセン サ,近赤外InGaAsイメージセンサなどの設計,開発に 従事.